04

Объемные пропускающие голограммы в кристаллах ниобата лития с поверхностным легированием медью для реализации фотовольтаичесих пинцетов

© Р.И. Анисимов, А.С. Темерева, А.А. Колмаков, С.М. Шандаров

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 634050 Томск, Россия

e-mail: roman.anisimov.00@mail.ru

Поступила в редакцию 07.08.2023 г. В окончательной редакции 07.08.2023 г. Принята к публикации 28.09.2023 г.

> Представлены результаты экспериментальных исследований, теоретического анализа и численного моделирования особенностей формирования объемных пропускающих голограмм картиной интерференции лазерных пучков с высоким контрастом в диффузионно-легированной пластине X-среза LiNbO₃:Cu с различающимися распределениями ионов меди Cu⁺ и Cu²⁺, каждое из которых описывается суммой постоянной составляющей и двух функций Гаусса. Получены аналитические выражения для описания временной эволюции амплитуды первой пространственной гармоники электрического поля фоторефрактивной голограммы, принимающие во внимание неоднородности распределения ионов меди и показателя поглощения записывающих пучков по толщине образца. Из сопоставления экспериментальных результатов с полученными теоретическими соотношениями оценены некоторые материальные параметры исследуемой структуры LiNbO₃:Cu. Проведен сравнительный анализ пространственного распределения для амплитуды первой гармоники поля фоторефрактивной голограммы в пластинах LiNbO₃:Cu двух типов. Получено, что для реализации фотовольтаических пинцетов необходимо использовать диффузионно-легированные структуры LiNbO₃:Cu X-среза с близкими распределениями донорных (Cu⁺) и ловушечных (Cu²⁺) центров с максимумами, локализованными вблизи границы, предназначенной для захвата микро- и наночастиц.

> Ключевые слова: фоторефрактивная голограмма, фотовольтаические пинцеты, ниобат лития, дифракционная эффективность, угловая селективность.

DOI: 10.61011/OS.2023.10.56888.5480-23

Введение

Один из подходов к реализации оптически управляемых манипуляторов микро- и нанообъектами заключается в использовании сильных эванесцентных электрических полей, возникающих над поверхностью кристаллов ниобата лития при их неоднородном освещении [1–6]. В качестве подложек для оптических пинцетов такого типа используются кристаллы ниобата лития, легированные железом [1–5] или медью [6], где ионы примеси обеспечивают высокий фотовольтаический отклик. Преимущества фотовольтаических пинцетов заключаются в возможности неоднократного использования монокристаллических подложек и в сведении к минимуму перегрева захватываемых объектов за счет применения маломощных источников излучения [5].

В работе [6] было продемонстрировано агрегирование диэлектрических наночастиц эванесцентными электрическими полями фоторефрактивных решеток на поверхности образца LiNbO₃: Cu, полученного диффузионным легированием пластины *X*-среза конгруэнтного ниобата лития из металлической пленки меди. Диффузия меди в образцы ниобата лития может проводиться при температурах 600°C [7], 800°C [8] и 1000°C [6,9–11], из металлических пленок Си [6,9–11] и порошкового оксида СиО [7,8].

Для реализации фотовольтаических пинцетов на основе диффузионно-легированных пластин LiNbO3 : Cu важными характеристиками являются распределения по глубине образца концентраций примесных центров C_{Cu+} и $C_{\mathrm{Cu}^{2+}}$, находящихся в зарядовых состояниях Cu^+ и Cu²⁺ соответственно [12]. Следует отметить, что приведенные в работах [6-11] сведения о характере данных распределений являются противоречивыми. Из представленных в [9] результатов следует, что в образце с толщиной 1 mm концентрация Cu⁺ с увеличением расстояния от Х-поверхности, на которую напылялась металлическая пленка меди, уменьшается всего на 20%. Однако в [6] распределение показателя поглощения $k_{523}(x)$ на длине волны 532 nm получено в виде функции Гаусса с полушириной $\Delta x = 316\,\mu{
m m}$ и с максимумом на Х-границе, через которую осуществлялась диффузия из металлической пленки Си. Для данного образца LiNbO3: Си при анализе формирования динамических фоторефрактивных решеток, проведенном в [12], предполагалось, что распределения концентрации ионов Cu⁺ и Cu²⁺ в поверхностном слое также являются гауссовыми и характеризуются такой же полушириной Δx , как и $k_{523}(x)$. Авторами [8] получено, что при диффузии из порошкового оксида СuO в образцах в виде прямоугольного параллелепипеда с гранями, параллельными кристаллофизическим осям X, Y и Z, зависимости концентрации ионов Cu⁺ и Cu²⁺ от глубины L различаются, имеют немонотонное поведение и характеризуются максимумами, расположенными при $L \approx 400-500 \,\mu\text{m}$ для Cu⁺ и $L \approx 200-300 \,\mu\text{m}$ для Cu²⁺. Они отмечают отличие полученных ими распределений Cu⁺(L) и Cu²⁺(L) от предсказываемых простой моделью термической диффузии и полагают необходимым проведение дополнительных исследований ее механизма в случае Cu и ниобата лития.

Подробному экспериментальному исследованию распределений по координате х для концентрации ионов $C_{{
m Cu}^+}(x)$ и $C_{{
m Cu}^{2+}}(x)$ в диффузионно-легированной пластине LiNbO3: Си X-среза посвящена работа [11]. Исходная пластина конгруэнтного ниобата лития имела толщину d = 1.33 mm; диффузия проводилась из металлической пленки с толщиной 600 nm, нанесенной на грань x = 0 пластины методом магнетронного распыления в течение 9 h при температуре $T = 1000^{\circ}$ C. После проведения диффузии из пластины LiNbO3: Си резкой и оптической полировкой была получена клинообразная область с углом наклона $\gamma = 36^{\circ}$ к плоскости x = d. Измерение зависимостей показателей поглощения на длинах волн 532 и 808 nm, пропорциональных концентрациям $C_{Cu^+}(x)$ и $C_{Cu^{2+}}(x)$ соответственно, от толщины клинообразной области h_w позволило авторам [11] аппроксимировать их суммой двух функций Гаусса. Можно предположить, что в процессе диффузии оба типа ионов будут иметь ненулевую концентрацию по всей толщине образца LiNbO3: Си. Поэтому для описания распределений $C_{Cu^+}(x)$ и $C_{Cu^{2+}}(x)$ в них следует учесть и постоянные составляющие с небольшими значениями $C_{Cu^{+}}^{0}$ и $C_{Cu^{2+}}^{0}$, сравнимыми с точностью экспериментальных измерений по показателям поглощения. Используя данные [11], в результате получаем

$$C_{\mathrm{Cu}^{+}}(x) = C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{m_{1}} \exp\left[-\frac{(x-x_{1}^{+})^{2}}{(\Delta x_{1}^{+})^{2}}\right] + C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{m_{2}} \exp\left[-\frac{(x-x_{2}^{+})^{2}}{(\Delta x_{2}^{+})^{2}}\right] + C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{0}, \quad (1)$$

$$C_{\mathrm{Cu}^{2+}}(x) = C_{\mathrm{Cu}^{2+}}^{m1} \exp\left[-\frac{(x-x_1^{2+})^2}{(\Delta x_1^{2+})^2}\right] + C_{\mathrm{Cu}^{2+}}^{m2} \exp\left[-\frac{(x-x_2^{2+})^2}{(\Delta x_2^{2+})^2}\right] + C_{\mathrm{Cu}^{2+}}^0$$
(2)

с максимальными значениями $C_{\text{Cu}^+}^{m1} = 4.20 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$, $C_{\text{Cu}^+}^{m2} = 8.02 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}$, $C_{\text{Cu}^2+}^{m1} = 2.26 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3}$ и $C_{\text{Cu}^{2+}}^{m2} = 1.64 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3}$ и с пространственными параметрами $x_1^+ = 95 \,\mu\text{m}$, $x_2^+ = 1215 \,\mu\text{m}$, $\Delta x_1^+ = 310 \,\mu\text{m}$, $\Delta x_1^2 = 70 \,\mu\text{m}$, $x_1^{2+} = 225 \,\mu\text{m}$, $x_2^{2+} = 1245 \,\mu\text{m}$, $\Delta x_1^2 = 130 \,\mu\text{m}$ и $\Delta x_2^{2+} = 37 \,\mu\text{m}$. Проведенные

исследования, описанные ниже, позволили оценить постоянные составляющие концентраций как $C_{\text{Cu}^+}^0 = 0.9 \cdot 10^{24} \,\text{m}^{-3}$ и $C_{\text{Cu}^{2+}}^0 = 2.0 \cdot 10^{25} \,\text{m}^{-3}$. При анализе формирования объемных пропускающих голограмм в таких образцах LiNbO₃ : Си необходимо учитывать сложный характер распределения ионов меди, обеспечивающих процессы фотовозбуждения с донорных центров Cu⁺ электронов в зону проводимости с их последующей рекомбинации на ловушки Cu²⁺.

Целью настоящей работы является исследование особенностей формирования фоторефрактивных решеток картиной интерференции записывающих лазерных пучков с высоким контрастом в пластине *X*-среза LiNbO₃:Си с различающимися распределениями ионов Cu⁺ и Cu²⁺, каждое из которых описывается суммой постоянной составляющей и двух функций Гаусса.

Теоретическая модель и приближения

Рассмотрим формирование поля пространственного заряда $\mathbf{E}(x, z, t)$ фоторефрактивной решетки в приближении заданной интенсивности света J(x, z) в интерференционной картине, созданной двумя записывающими световыми волнами, распространяющимися симметрично относительно оси X в разомкнутом вдоль оси Z кристалле LiNbO₃:Сu. Будем полагать, что кванты записывающего излучения с энергией $\hbar\omega_w$ приводят к возбуждению электронов с донорных центров Cu⁺ в зону проводимости. Этот процесс будет сопровождаться оптическим поглощением с показателем, определяемым следующим выражением [13]:

$$\alpha_w(x) = \hbar \omega_w S_w [N_D(x) - N_A(x)] = \hbar \omega_w S_w C_{\mathrm{Cu}^+}(x), \quad (3)$$

где S_w — сечение фотоионизации для центров данного типа. Как и в [12], здесь учтено, что общая концентрация дефектных центров $N_D(x)$, между которыми происходит фотоиндуцированное перераспределение зарядов при неоднородном освещении, и концентрация компенсирующих акцепторов $N_A(x)$, в темновых условиях равная концентрации ионизированных донорных центров, играющих роль ловушек электронов, определяются выражениями

$$N_D(x) = C_{Cu^+}(x) + C_{Cu^{2+}}(x)$$
(4)

И

$$N_A(x) = C_{Cu^{2+}}(x).$$
(5)

С учетом зависимости показателя поглощения от координаты x, определяемой формулами (3) и (1), распределение интенсивности света для картины интерференции в пластине LiNbO₃: Си может быть получено

в следующем виде:

$$J(x, z) = J_0 \exp\left\{-\hbar\omega_w S_w \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(C_{\mathrm{Cu}^+}^{m1} \Delta x_1^+ \left\{ \mathrm{erf}\left(\frac{x_1^+}{\Delta x_1^+}\right) + \mathrm{erf}\left(\frac{x-x_1^+}{\Delta x_1^+}\right) \right\} + C_{\mathrm{Cu}^+}^{m2} \Delta x_2^+ \left\{ \mathrm{erf}\left(\frac{x_2^+}{\Delta x_2^+}\right) + \mathrm{erf}\left(\frac{x-x_2^+}{\Delta x_2^+}\right) \right\} \right) + C_{\mathrm{Cu}^+}^0 x_1^- \left[1 + m\cos\left(\frac{2\pi}{\Lambda}z\right)\right],$$

$$(6)$$

где erf($x/\Delta x$) — интеграл вероятности [14]. Следуя работе [12] и известной одноуровневой модели зонного переноса [13], пренебрежем диффузионным механизмом перераспределения пространственного заряда и эффектом насыщения ловушек, а также воспользуемся приближениями медленных изменений всех рассматриваемых функций вдоль координаты $x (\partial J/\partial x \ll \partial J/\partial z,$ $|\partial \mathbf{E}/\partial x| \ll |\partial \mathbf{E}/\partial z|$, и т.д.), низкой интенсивности света J(x, z) и адиабатического следования концентрации электронов в зоне проводимости ее временным изменениям. В результате уравнение, описывающее временную эволюцию преобладающей компоненты электрической напряженности поля пространственного заряда $E_z(x, z, t) = E(x, z, t)$, принимает следующий вид [12]:

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{e\mu S_w}{\varepsilon_3 \gamma N_A} \left(N_D - N_A \right) JE + \frac{GS_w \hbar \omega_w}{\varepsilon_3} \left(N_D - N_A \right) J = 0,$$
⁽⁷⁾

где e — элементарный электрический заряд; ε_3 — статическая диэлектрическая проницаемость кристалла для поля вдоль полярной оси Z; μ — подвижность электронов вдоль данной оси; G — константа Гласса, зависящая от поляризации света, формирующего фоторефрактивную решетку [15]; и γ — коэффициент двухчастичной рекомбинации.

Для начального условия E(x, z, 0) = 0, соответствующего включению записывающих световых пучков при t = 0, решение (7) было получено в [12] в следующем виде:

$$E(x, z, t) = -\frac{G\hbar\omega_w \gamma N_A(x)}{e\mu} \left\{ 1 - \exp\left[-\frac{t}{\tau(x)}\right] \times \exp\left[-\frac{mt}{\tau(x)}\cos\left(\frac{2\pi}{\Lambda}z\right)\right] \right\},$$
(8)

где Λ — пространственный период решетки. Однако время релаксации $\tau(x)$ в этом выражении будет определяться сложными зависимостями (1) и (2) от координаты *x* для концентраций ионов Cu⁺ и Cu²⁺, а также распределением средней интенсивности света в кристалле, которое следует из (6):

$$\frac{C_{\text{Cu}^{+}}^{m1} \exp\left[-(x-x_{1}^{+})^{2}/(\Delta x_{1}^{+})^{2}\right]}{\tau(x)} = J_{0} \frac{e\mu S_{w}}{\varepsilon_{3}\gamma} \frac{+C_{\text{Cu}^{+}}^{m2} \exp\left[-(x-x_{2}^{+})^{2}/(\Delta x_{2}^{+})^{2}\right] + C_{\text{Cu}^{+}}^{0}}{C_{\text{Cu}^{2+}}^{m1} \exp\left[-(x-x_{1}^{2+})^{2}/(\Delta x_{1}^{2+})^{2}\right]} + C_{\text{Cu}^{2+}}^{m2} \exp\left[-(x-x_{2}^{2+})^{2}/(\Delta x_{2}^{2+})^{2}\right] + C_{\text{Cu}^{2+}}^{0}} \\ \times \exp\left\{-\hbar\omega_{w}S_{w}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(C_{\text{Cu}^{+}}^{m1}\Delta x_{1}^{+}\left\{\text{erf}\left(\frac{x_{1}^{+}}{\Delta x_{1}^{+}}\right)\right.\right.\right. \\ \left. + \exp\left(\frac{x-x_{1}^{+}}{\Delta x_{1}^{+}}\right)\right\} + C_{\text{Cu}^{+}}^{m2}\Delta x_{2}^{+}\left\{\text{erf}\left(\frac{x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right)\right. \\ \left. + \exp\left(\frac{x-x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right)\right\} + C_{\text{Cu}^{+}}^{0}x_{2}^{+}\left\{\text{erf}\left(\frac{x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right)\right. \\ \left. + \exp\left(\frac{x-x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right)\right\} + C_{\text{Cu}^{+}}^{0}x_{2}^{+}\left\{\text{erf}\left(\frac{x-x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right)\right\}.$$

$$(9)$$

Как отмечалось в [12], формирующееся в пластине LiNbO₃: Си поле пространственного заряда фоторефрактивной решетки представляет собой суперпозицию пространственных гармоник вида

$$E_{sc}^{(n)}(x, z, t) = E_n(x, t) \cos(2\pi n/\Lambda)$$
 (10)

с номерами n = 0, 1, 2, ... и амплитудами $E_n(x, t)$. Эти амплитуды могут быть найдены с использованием разложения последнего экспоненциального множителя в (8) в ряд по модифицированным функциям Бесселя *n*-го порядка, $I_n(mt/\tau(x))$. Для амплитуды первой гармоники $E_n(x, t)$ при n = 1 из (10), которая определяет эффективность дифракции Брэгга на фоторефрактивной решетке, из соотношений (8), (5) и (2) может быть найдено следующее аналитическое выражение:

$$E_{1}(x,t) = -\frac{2G\hbar\omega_{w}\gamma}{e\mu} \left\{ C_{\mathrm{Cu}^{2+}}^{m1} \exp\left[-\frac{(x-x_{1}^{2+})^{2}}{(\Delta x_{1}^{2+})^{2}}\right] + C_{\mathrm{Cu}^{2+}}^{m2} \right\}$$
$$\times \exp\left[-\frac{(x-x_{2}^{2+})^{2}}{(\Delta x_{2}^{2+})^{2}}\right] + C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{0} \left\{ I_{1}\left(\frac{mt}{\tau(x)}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau(x)}\right).$$
(11)

Как следует из (11), динамика формирования фоторефрактивной голограммы, для которой эффективность брэгговской дифракции зондирующего пучка определяется именно амплитудой поля первой пространственной гармоники, в рассматриваемом образце LiNbO₃ : Си имеет сложный характер, зависящий от распределений для концентраций ионов меди в обоих зарядовых состояниях, $C_{\text{Cu}^+}(x)$ и $C_{\text{Cu}^{2+}}(x)$. Однако нарастание этой амплитуды во времени на начальном участке, при $t \ll \tau(x)$, происходит, как следует из (11) и (9), по линейному закону. При этом неоднородное пространственное распределение по координате x на данном участке сохраняется и определяется исключительно распределением фотовольтаически активных донорных центров $C_{\mathrm{Cu}^+}(x)$:

$$\begin{split} E_{1}^{in}(x,t) &= -mJ_{0} \frac{G\hbar\omega_{w}S_{w}}{\varepsilon_{3}} t \left\{ C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{m1} \exp\left[-\frac{(x-x_{1}^{+})^{2}}{(\Delta x_{1}^{+})^{2}}\right] \right. \\ &+ C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{m2} \exp\left[-\frac{(x-x_{2}^{+})^{2}}{(\Delta x_{2}^{+})^{2}}\right] + C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{0} \right\} \exp\left\{-\hbar\omega_{w}S_{w} \right. \\ &\times \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{m1}\Delta x_{1}^{+} \left\{ \mathrm{erf}\left(\frac{x_{1}^{+}}{\Delta x_{1}^{+}}\right) + \mathrm{erf}\left(\frac{x-x_{1}^{+}}{\Delta x_{1}^{+}}\right) \right\} \right. \\ &+ C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{m2}\Delta x_{2}^{+} \left\{ \mathrm{erf}\left(\frac{x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right) + \mathrm{erf}\left(\frac{x-x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right) \right\} \right) + C_{\mathrm{Cu}^{+}}^{0}x \right] \right\}. \end{split}$$

Для контроля дифракционной эффективности рассматриваемой фоторефрактивной голограммы целесообразно использование лазерного излучения с длиной волны $\lambda_r > \lambda_w$, при которой образец LiNbO₃ : Си имеет низкую фоторефрактивную чувствительность и пренебрежимо малое значение среднего показателя поглощения [10,12]. В этом случае эффективность дифракции Брэгга в первый порядок будет максимальна при необыкновенном зондирующем пучке с величиной $\eta(t)$, определяемой амплитудой возмущения необыкновенного показателя преломления, создаваемого записывающими пучками в пластине LiNbO₃ : Cu:

$$\Delta n_e(x,t) = -\frac{n_e^3 r_{33}}{2} E_1(x,t), \qquad (13)$$

где n_e — необыкновенный показатель преломления невозмущенного кристалла и r_{33} — его электрооптическая постоянная. Для малых значений $\eta(t)$, не превосходящих нескольких процентов, при теоретическом анализе изменением амплитуды считывающей волны A_r за счет преобразования в дифрагированный пучок можно пренебречь. Пренебрегая также ее оптическим поглощением, учитывая малость угла Брэгга $\theta_{\rm B}$ и угла падения зондирующего пучка θ_i и используя известный подход [16,17], уравнение для пространственной эволюции амплитуды дифрагированной световой волны $A_d(x, t)$ с учетом (13) представим в следующем виде:

$$\frac{dA_d}{dx} = -i \frac{\pi}{2\lambda_r} n_e^3 r_{33} E_1(x, t) A_r \exp(i\Delta kx)$$
(14)

с параметром волновой расстройки, определяемым отклонением в кристалле угла падения зондирующего пучка θ_i от θ_B :

$$\Delta k \simeq \frac{2\pi}{\Lambda} \left(\sin \theta_i - \sin \theta_{\rm B} \right). \tag{15}$$

Полученные в рамках рассматриваемой модели соотношения позволяют описать формирование поля пространственного заряда и временную динамику дифракционной эффективности фоторефрактивных голограмм,



Рис. 1. Временная зависимость дифракционной эффективности на начальном участке формирования динамической фоторефрактивной решетки в исследуемом образце LiNbO₃:Cu. Точки — экспериментальные данные; сплошная линия — аппроксимация по формуле (16) при $b = 7.63 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-2}$ и $c = -2.66 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-3}$.

формируемых в пластинах X-среза LiNbO₃: Си с различающимися распределениями ионов Cu⁺ и Cu²⁺, каждое из которых описывается суммой постоянной составляющей и двух функций Гаусса, картиной интерференции записывающих лазерных пучков с высоким контрастом.

Эксперимент

Для формирования динамических фоторефрактивных голограмм с пространственным периодом $\Lambda = 12 \, \mu m$ использовалась картина интерференции с контрастом $m \approx 0.98$ и вектором решетки, параллельным полярной оси Z, двух записывающих лазерных пучков с длиной волны $\lambda_w = 532 \,\mathrm{nm}$ и мощностями $P_1 \approx 0.98 \,\mathrm{mW}$, $P_2 \approx 1.45 \,\mathrm{mW}$. Они соответствовали обыкновенным волнам, имели апертуру $D_w = 1.1 \, \text{mm}$ и обеспечивали среднюю интенсивность интерференционной картины $J_0 \approx 472 \,\mathrm{W/m^2}$ на входной грани x = 0 (см. формулу (6)) описанного выше образца LiNbO₃: Си с распределениями концентрации ионов меди, аппроксимируемыми соотношениями (1) и (2). Контроль дифракционной эффективности формируемой объемной решетки, как и в [12], осуществлялся зондирующим пучком полупроводникового лазера с $\lambda_r = 650 \,\mathrm{nm}$ и мощностью 4.3 mW, распространяющимся в виде необыкновенной волны под соответствующим углом Брэгга к оси Х образца. Наблюдаемая зависимость роста дифракционной эффективности $\eta_{in}(t)$ на начальном участке записи фоторефрактивной решетки, измеренная с использованием фотодиода ФД-24К и цифрового осциллографа Tektronix TDS2022C, представленная точками на рис. 1, удовлетворительно аппроксимировалась функцией

$$\eta_{in}(t) = bt^2 + ct^3, \qquad (16)$$



Рис. 2. Зависимость нормированной дифракционной эффективности от угла отстройки $\Delta \theta = \theta_{ia} - \theta_{Ba}$ между углом падения и углом Брэгта в воздухе. Круги — экспериментальные данные, треугольники — отображение экспериментальных данных на область $\Delta \theta < 0$, сплошная кривая — расчет по формуле Когельника.

показанной сплошной кривой, при значениях коэффициентов $b = 7.63 \cdot 10^{-5} \,\mathrm{s}^{-2}$ и $c = -2.66 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{s}^{-3}$.

Экспериментальное исследование угловой селективности проводилось на длине волны $\lambda_r = 650 \,\mathrm{nm}$ для фоторефрактивной голограммы с тем же пространственным периодом $\Lambda = 12 \,\mu m$ и с дифракционной эффективностью, достигающей значения $\eta_m = 0.003$ при точном выполнении условия Брэгга. Время ее записи при $\lambda_w = 532 \,\mathrm{nm}$ и мощностях пучков $P_1 \approx 0.95 \,\mathrm{mW}$ и $P_2 \approx 1.46 \,\mathrm{mW} \,(m \approx 0.98)$ составляло 7 s. После формирования голограммы образец LiNbO3: Си устанавливался на поворотном столике, позволявшем фиксировать отстройку угла падения света θ_{ia} на входную грань x = 0 от угла Брэгга θ_{Ba} в воздухе, $\Delta \theta = \theta_{ia} - \theta_{Ba}$, с точностью до одной угловой минуты. Зависимость мощности дифрагированного света от угла отстройки регистрировалась для $\Delta \theta \ge 0$ в предположении ее симметричности. Нормированная экспериментальная угловая зависимость дифракционной эффективности $\eta(\Delta \theta)$ (показана кругами), измеренная с использованием измерителя мощности PM130D, и ее предполагаемое поведение для $\Delta \theta < 0$, отображенное треугольниками, иллюстрируются рис. 2.

Сплошной кривой на данном рисунке показана известная теоретическая зависимость Когельника [16] для угловой селективности объемной синусоидальной фазовой решетки с однородным распределением амплитуды возмущений показателя преломления $\Delta n_m(x)$, рассчитанная при $0 \le x \le d_{\rm ef}$ для эффективной длины взаимодействия $d_{\rm ef} = 0.7$ mm. В этом приближении, не учитывающем реальное распределение $\Delta n_m(x)$ по исследуемому образцу, данная зависимость удовлетворительно описывает только основной максимум кривой селективности.

Оценка константы Гласса и анализ угловой селективности

Для описания представленной на рис. 1 квадратичной временной зависимости для дифракционной эффективности $\eta_{in}(t)$ на начальном участке формирования фоторефрактивной голограммы обыкновенными световыми пучками с $\lambda_w = 532$ nm, следуя подходу [12], воспользуемся соотношением (12) для $E_1^{in}(x, t)$ при соответствующей константе Гласса G_0 . Последующая подстановка $E_1^{in}(x, t)$ в (14) и его интегрирование с учетом точного выполнения условия Брэгга $\Delta k = 0$ позволяет представить временную зависимость $\eta_{in}(t)$ в следующей форме:

$$\eta_{in}(t) = \left(\frac{\pi n_e^3 r_{33}}{2\lambda_r} \frac{G_0 \hbar \omega_w S_w C_{\mathrm{Cu}^+}^{m1} m J_0}{\varepsilon_3} d_{\mathrm{ef}}^{in}\right)^2 t^2, \qquad (17)$$

где эффективная длина взаимодействия определяется интегральным выражением

$$d_{\rm ef}^{in} = \int_{0}^{d} \left\{ \exp\left[-\frac{(x-x_{1}^{+})^{2}}{(\Delta x_{1}^{+})^{2}}\right] + \frac{C_{\rm Cu^{+}}^{m2}}{C_{\rm Cu^{+}}^{m1}} \exp\left[-\frac{(x-x_{2}^{+})^{2}}{(\Delta x_{2}^{+})^{2}}\right] + \frac{C_{\rm Cu^{+}}^{0}}{C_{\rm Cu^{+}}^{m1}} \right\} \exp\left\{-\hbar\omega_{w}S_{w}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(C_{\rm Cu^{+}}^{m1}\Delta x_{1}^{+}\left\{ \exp\left(\frac{x_{1}^{+}}{\Delta x_{1}^{+}}\right) + \exp\left(\frac{x-x_{1}^{+}}{\Delta x_{1}^{+}}\right)\right\} + C_{\rm Cu^{+}}^{m2}\Delta x_{2}^{+}\left\{ \exp\left(\frac{x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right) + \exp\left(\frac{x-x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right)\right\} + C_{\rm Cu^{+}}^{0}\Delta x_{2}^{+}\left\{ \exp\left(\frac{x-x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right) + \exp\left(\frac{x-x_{2}^{+}}{\Delta x_{2}^{+}}\right)\right\} + C_{\rm Cu^{+}}^{0}x_{2}^{+} \right\} dx.$$

$$(18)$$

Сопоставление уравнений (16) и (17) с учетом (18), использование приведенных выше параметров диффузионной структуры LiNbO₃:Cu, условий и результатов эксперимента, сечения фотоионизации $S_w = 2.0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{J}$ [12], литературных данных по материальным параметрам ниобата лития из [15,18], а также значения $C_{\text{Cu}^+}^0 = 9 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$ позволило оценить эффективную длину взаимодействия на начальном участке формирования фоторефрактивной голограммы как $d_{\text{ef}}^{in} \approx 0.23 \text{ mm}$ и константу Гласса для записывающих обыкновенных волн с $\lambda_w = 532 \text{ nm}$ как $G_0 \approx 8.0 \text{ pm/V}$. Полученное значение является близким по порядку величины к приведенной в [15] константе Гласса для кристаллов LiNbO₃:Cu с объемным легированием, равной 5.5 pm/V.

Нормированная угловая зависимость дифракционной эффективности фоторефрактивной голограммы при ее малых значениях и произвольном времени формирования в рассматриваемой диффузионной структуре LiNbO₃:Си может быть получена из (14) и (15) в сле-

дующем виде:

$$\eta_n(\theta_{ia}, t) = \left| \int_0^d E_1(x, t) \exp\left[i \frac{2\pi}{\Lambda n_e} \left(\sin \theta_{ia} - \frac{\lambda_r}{2\Lambda} \right) \right] dx \right|^2 \\ / \left| \int_0^d E_1(x, t) dx \right|^2,$$
(19)

где амплитуда первой пространственной гармоники $E_1(x, t)$ определяется соотношениями (11) и (9). Результаты численного моделирования данной угловой зависимости для значений используемых подгоночных параметров $C_{\text{Cu}^+}^0 = 9 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$, $C_{\text{Cu}^{2+}}^0 = 2 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$ и $\gamma/\mu = 5.7 \cdot 10^{-12} \text{ m} \cdot \text{V}$ показаны на рис. 3 сплошной кривой.

Как следует из рис. 3, используемая модель формирования поля пространственного заряда фоторефрактивной голограммы картиной интерференции с высоким контрастом $m \approx 1$ в исследуемом кристалле X-среза LiNbO₃:Си с диффузионным легированием, предполагающая наличие в нем различающихся распределений ионов Cu⁺ и Cu²⁺, каждое из которых представляется суммой постоянной составляющей и двух функций Гаусса, удовлетворительно описывает кривую угловой селективности для ее трех главных лепестков. Значительные различия между экспериментальными и расчетными данными для отстройки от угла Брэгга $|\Delta \theta| > 2.2 \deg$ могут быть связаны с принятыми приближениями и с погрешностями в определении параметров для распределений $C_{Cu^+}(x)$ и $C_{cu^{2+}}(x)$.

Численное моделирование пространственного распределения и динамики поля пространственного заряда

Для расчета распределения амплитуды поля пространственного заряда $E_1(x, t)$ по глубине кристалла в различные моменты времени после начала записи фоторефрактивной голограммы могут быть использованы соотношения (11) и (9). Как из них следует, амплитуда $E_1(x, t)$ сложным образом зависит от распределений по кристаллу концентраций ионов $C_{\text{Cu}^+}(x)$ и $C_{\text{Cu}^{2+}}(x)$. Ограничимся ниже анализом двух структур LiNbO₃: Cu, первая из которых рассмотрена выше, а вторая описана в работе [12], с распределениями концентраций ионов меди, иллюстрируемых рис. 4, *a* и 4, *b* соответственно.

Следует отметить, что локализация главных максимумов для распределений донорных и ловушечных центров, которыми являются ионы в зарядовых состояниях Cu^+ и Cu^{2+} соответственно, в первом образце LiNbO₃: Си различна. При этом концентрации ловушек



Рис. 3. Зависимость нормированной дифракционной эффективности от угла отстройки $\Delta \theta$ между углом падения θ_{ia} и углом Брэгга θ_{Ba} в воздухе, $\Delta \theta = \theta_{ia} - \theta_{Ba}$. Точки соответствуют данным, представленным на рис. 2. Сплошная кривая — расчетная зависимость по соотношениям (19), (11) и (9).



Рис. 4. Распределения концентраций ионов в зарядовых состояниях Cu^+ и Cu^{2+} по глубине диффузионно-легированных образцов LiNbO₃:Cu, описанных в настоящей работе (*a*) и в [12] (*b*).

вблизи граней кристалла x = 0 и x = d = 1.33 mm имеют существенно меньшее значение, чем на удалении от них, при $x = 225 \,\mu$ m и $x = 1245 \,\mu$ m.



Рис. 5. Распределение амплитуды поля первой пространственной гармоники фоторефрактивной голограммы с пространственным периодом $12 \,\mu$ m по глубине в описанном в настоящей работе диффузионно-легированном образце X-среза LiNbO₃: Cu с представленными на рис. 4, *а* зависимостями $C_{\text{Cu}^+}(x)$ и $C_{\text{Cu}^{2+}}(x)$, при записи интерференционной картиной с интенсивностью $J_0 \approx 472 \,\text{W/m}^2$ и контрастом $m \approx 0.98$ в различные моменты времени $t_w = 1$ (1), 2 (2), 8 (3) и 24 s (4).

Результаты расчета $E_1(x, t_i)$ для данного образца LiNbO₃: Си при рассмотренных выше параметрах распределений $C_{\text{Cu}^+}(x)$ и $C_{\text{Cu}^{2+}}(x)$ и полученных из эксперимента оценок для G_0 и γ/μ , с использованием значения сечения фотоионизации $S_w = 2.0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{J}$ [12] и литературных данных по материальным параметрам ниобата лития из [15,18] представлены на рис. 5.

Как видно из рис. 5, динамика формирования первой пространственной гармоники электрического поля голограммы с амплитудой $E_1(x, t)$ в исследуемой структуре LiNbO3: Си имеет сложный характер. Уже на начальной стадии записи, при $t_w = 1 \, \text{s}$ (кривая 2), координатная зависимость амплитуды поля не соответствует распределению концентрации донорных центров $C_{\mathrm{Cu}^+}(x)$ по глубине кристалла (рис. 4, *a*). Расчеты показывают, что для использованных параметров модели и условий эксперимента длительность начального участка, когда основной вклад в динамику поля пространственного заряда вносят процессы фотовозбуждения электронов в зону проводимости с донорных центров Cu⁺ и ее можно описать соотношением (12), не превышает 0.01 s. Далее основную роль начинает играть ток проводимости, величина которого пропорциональна подвижности электронов µ, и их рекомбинация из зоны проводимости на ловушечные центры Cu²⁺ со скоростью, определяемой величиной $(\gamma C_{\mathrm{Cu}^{2+}}(x))^{-1}$. Используемое при численном моделировании динамики амплитуды поля $E_1(x, t)$ значение $\gamma/\mu = 5.7 \cdot 10^{-12} \,\mathrm{m \cdot V}$, найденное из подгонки кривой угловой селективности (рис. 3), существенно отличается от литературных данных для объемно-легированных кристаллов LiNbO₃: Cu, $\gamma/\mu = 7.2 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{V}$ (см., например, [12]). Причины такого отличия для исследованной структуры с диффузионным легированием требуют дальнейшего изучения.

Характерно, что амплитуда первой пространственной гармоники электрического поля фоторефрактивной голограммы на границе x = 0 данной структуры $E_1(0, t)$ убывает со временем записи. Поэтому она не подходит для реализации на ее основе фотовольтаических пинцетов. Из рис. 4, *a* и рис. 5 следует, что максимумы этой амплитуды приблизительно соответствуют максимумам в распределении концентрации ловушек $C_{\text{Си}^{2+}}(x)$.

Результаты расчета $E_1(x, t_w)$ для структуры LiNbO₃: Cu, описанной в работе [12], с использованием приведенных в ней значений для материальных параметров $G_e \approx 4.6 \text{ pm/V}, \quad \gamma = 5.3 \cdot 10^{-13} \text{ m}^3/\text{s}, \mu = 7.4 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ и для гауссовых распределений концентрации ионов меди $C_{\text{Cu}^2+}^m = 7.8 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}, C_{\text{Cu}^{2+}}^m = 6.5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$ и $\Delta x^+ = \Delta x^{2+} = 316 \,\mu\text{m}$, а также для экспериментальных характеристик записывающей интерференционной картины m = 1 и $J_0 = 2600 \text{ W/m}^2$ приведены на рис. 6.

В таком образце при совпадающем характере распределений донорных и ловушечных центров наблюдается монотонный рост во времени амплитуды первой пространственной гармоники $E_1(x, t_w)$ по всей его глубине. При этом ее максимальное значение достигается на границе структуры LiNbO₃: Си x = 0, обеспечивая над нею, при x < 0, значительные эванесцентные поля с амплитудами более 1 MV/m при временах записи $t_w > 60$ s. Таким образом, для реализации фотовольта-ических пинцетов оптимальным является использова-



Рис. 6. Распределение амплитуды поля первой пространственной гармоники фоторефрактивной голограммы с пространственным периодом 2.5 μ m по глубине для описанного в [12] диффузионно-легированного образца X-среза LiNbO₃: Cu с представленными на рис. 4, *b* зависимостями $C_{Cu^+}(x)$ и $C_{Cu^{2+}}(x)$ при записи интерференционной картиной с интенсивностью $J_0 = 2600 \text{ W/m}^2$ и контрастом m = 1 в течение различных интервалов времени: $t_w = 10$ (*I*), 60 (*2*), 120 (*3*) и 270 s (*4*).

ние диффузионно-легированных образцов LiNbO₃: Cu Xсреза с близкими распределениями донорных (Cu⁺) и ловушечных (Cu²⁺) центров с максимумами, локализованными вблизи границы, предназначенной для захвата микро- и нанообъектов за счет диэлектрофоретических сил. Для создания таких структур необходима корректная модель процессов диффузии меди в кристаллы ниобата лития, которая в настоящее время отсутствует.

Заключение

Таким образом, в работе рассмотрены особенности формирования объемных пропускающих голограмм в пластинах Х-среза ниобата лития с диффузионным легированием медью с целью реализации фотовольтаических пинцетов. Экспериментальные исследования и численное моделирование проводились для образца LiNbO3 : Cu Х-среза, описанного в [9], где распределение концентрации ионов меди в зарядовых состояниях Cu⁺ и Cu²⁺ было предложено аппроксимировать различающимися суммами двух функций Гаусса. В предположении, что в процессе диффузии оба типа ионов могут иметь ненулевую концентрацию по всей толщине пластины LiNbO3: Си при численном моделировании в этих распределениях учитывались и постоянные составляющие концентраций с небольшими значениями $C_{Cu^+}^0$ и $C_{Cu^{2+}}^0$. Использование развитого в [12] подхода позволило получить (в приближениях заданной интенсивности света в интерференционной картине с произвольным контрастом, отсутствия насыщения ловушек и диффузионного тока, а также медленных изменений всех функций вдоль координаты x) аналитические выражения для описания временной эволюции амплитуды первой пространственной гармоники поля $E_1(x, t)$, принимающие во внимание неоднородности распределения ионов Cu⁺ и Cu²⁺ и показателя поглощения записывающих пучков по толщине образца.

Из сопоставления с полученными теоретическими соотношениями результатов экспериментальных исследований эффективности дифракции Брэгга считывающего пучка для начального участка формирования фоторефрактивной голограммы ($t_w < 3$ s) и ее угловой селективности (при времени записи $t_w = 7$ s, для картины интерференции записывающих световых пучков ($\lambda_w = 532$ nm) с контрастом $m \approx 0.98$ и средней интенсивностью $J_0 \approx 470 \text{ W/m}^2$) оценены материальные параметры структуры LiNbO₃:Сu, такие как константа Гласса для обыкновенных волн $G_0 \approx 8.0 \text{ pm/V}$, отношение коэффициента двухчастичной рекомбинации к подвижности электронов вдоль полярной оси $\gamma/\mu = 5.7 \cdot 10^{-12} \text{ m} \cdot \text{V}$ и постоянные составляющие в распределениях концентраций ионов меди $C_{Cu^+}^0 = 9 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$ и $C_{Cu^{2+}}^0 = 2 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

С использованием численного моделирования по полученным соотношениям проведен сравнительный анализ пространственного распределения для амплитуды первой гармоники электрического поля фоторефрактивной голограммы в двух структурах LiNbO3: Cu: pacсмотренной в настоящей работе и описанной в [12]. Установлено, что амплитуда первой пространственной гармоники электрического поля фоторефрактивной голограммы для первой структуры достигает максимума, примерно соответствующего максимуму в распределении концентрации ловушек $C^0_{Cu^{2+}}(x)$ на расстоянии около 250 μ m от границы x = 0, где поле $E_1(0, t)$ невелико и убывает со временем записи. Поэтому такие структуры не подходят для реализации на их основе фотовольтаических пинцетов. Для второй структуры (с гауссовыми распределениями концентрации донорных и ловушечных центров, с локализацией максимумов $C^m_{\mathrm{Cu}^+}$ и $C^m_{\mathrm{Cu}^{2+}}$ соответственно при x=0) наблюдается монотонный рост во времени амплитуды первой пространственной гармоники $E_1(x, t)$ по всей ее глубине с максимальным значением $E_1(0, t)$. При времени записи голограммы $t_w > 60$ s для этой структуры реализуются эванесцентные поля с амплитудами более 1 MV/m. Это позволяет сделать вывод о необходимости использования для реализации фотовольтаических пинцетов диффузионных структур LiNbO3: Си X-среза с близкими распределениями донорных (Cu⁺) и ловушечных (Cu²⁺) центров с максимумами, локализованными вблизи границы, предназначенной для захвата микро- и наночастиц за счет диэлектрофоретических сил.

Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки и высшего образования Российской Федерации в рамках Госзадания FEWM-2023-0012 на 2023 г.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- J. Villarroel, H. Burgos, Á. García-Cabañes, M. Carrascosa, A. Blázquez-Castro, F. Agulló-López. Opt. Express, 19 (24), 24320 (2011). DOI: 10.1364/OE.19.024320
- M. Esseling, A. Zaltron, N. Argiolas, G. Nava, J. Imbrock, I. Cristiani, C. Sada, C. Denz. Appl. Phys. B, 113 (2), 191 (2013). DOI: 10.1007/s00340-013-5456-8
- J. Matarrubia, A. García-Cabañes, J.L. Plaza, F. Agulló-López, M. Carrascosa. J. Phys. D: Appl. Phys., 47 (26), 265101 (2014). DOI: 10.1088/0022-3727/47/26/265101
- [4] M. Carrascosa, A. García-Cabañes, M. Jubera, J.B. Ramiro,
 F. Agulló-López. Appl. Phys. Rev., 2 (4), 040605 (2015).
 DOI: 10.1063/1.4929374
- [5] A. Blázquez-Castro, A. García-Cabañes, M. Carrascosa. Appl. Phys. Rev., 5 (4), 41101 (2018). DOI: 10.1063/1.5044472
- [6] К.М. Мамбетова, С.М. Шандаров, А.И. Татьянников, С.В. Смирнов. Изв. вузов. Физика, 62 (4), 89 (2019). DOI: 10.17223/00213411/62/4/89

- [7] S. Kar, K.S. Bartwal. Materials Lett., 62 (24), 3934 (2008).
 DOI: 10.1016/j.matlet.2008.05.031
- [8] D. Sugak, I.I. Syvorotka, U. Yakhnevych, O. Buryy, N. Martynyuk, S. Ubizskii, Ya. Zhydachevskyy, A. Suchocki, H. Kumar, V. Janyani, G. Singh. Acta Physica Polonica A, 133 (4), 965 (2018). DOI: 10.12693/APhysPolA.133.965
- [9] K. Peithmann, J. Hukriede, K. Buse, E. Krätzig. Phys. Rev. B, 61 (7), 4615 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.4615
- [10] К.М. Мамбетова, Н.Н. Смаль, С.М. Шандаров, Л.Н. Орликов, С.И. Арестов, С.В. Смирнов. Изв. вузов. Радиофизика, 57 (8), 675 (2014).
- [11] А.А. Колмаков, А.С. Темерева, Р.И. Анисимов, А.В. Михайленко, С.М. Шандаров, И.В. Тимофеев, М.В. Пятнов. В сб.: Сборник трудов XXXIII Всероссийской школысеминара Волновые явления: физика и применения" им. А.П. Сухорукова (Волны-2022"), под ред. А.Н. Калиша (М., 2022), с. 58.
- [12] К.М. Мамбетова, С.М. Шандаров, Л.Н. Орликов, С.И. Арестов, С.В. Смирнов, Л.Я. Серебренников, В.А. Краковский. Опт. и спектр., **126** (6), 23 (2019). DOI: 10.21883/OS.2019.06.47782.31-19
- [13] С.М. Шандаров, В.М. Шандаров, А.Е. Мандель, Н.И. Буримов. Фоторефрактивные эффекты в электрооптических кристаллах: монография (Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2012).
- [14] А. Анго. *Математика для электро- и радиоинженеров* (М.: Наука, 1967).
- [15] T. Volk, M. Wöhlecke. Lithium Niobate: Defects, Photorefraction and Ferroelectric Switching, 1st ed. (Springer Berlin, Heidelberg, 2008). DOI: 10.1007/978-3-540-70766-0
- [16] H. Kogelnik. Bell. Syst. Techn. J., 48 (9), 2909 (1969).
 DOI: 10.1002/j.1538-7305.1969.tb01198.x
- [17] Л.Н. Магдич, В.Я. Молчанов. Акустооптические устройства и их применение (Сов. Радио, М., 1978).
- [18] М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике (Наука, СПб., 1992).